

表1-1. 装置等の利用負担金表

| 装置等 | | | 利用料金(一時間当り) | | | | | | 設置場所 | |
|---------------|----------------|------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------------------|
| No. | 機器名 | メーカー名 | タイプA | タイプB | タイプC | タイプD | タイプE | タイプF | | |
| A ナノリソグラフィ装置 | A01 | 高速高精度電子ビーム描画装置 | ELIONIX/ELS-F125HS | 31,680円 | 45,260円 | 50,690円 | 63,360円 | 72,410円 | 90,520円 | イロローム |
| | A02 | 露光装置 (ステッパー) | NIKON/NSR-2205i11D | 12,670円 | 18,100円 | 20,280円 | 25,340円 | 28,970円 | 36,210円 | イロローム |
| | A03 | レーザー直接描画装置 | Heidelberg Instruments/DWL2000 | 8,600円 | 12,280円 | 13,760円 | 17,200円 | 19,650円 | 24,570円 | イロローム |
| | A06 | 紫外線露光装置 | MIKASA/MA-10 | 530円 | 760円 | 850円 | 1,060円 | 1,210円 | 1,510円 | イロローム |
| | A07 | 厚膜フォトリソ用スピンコーティング装置 | SUSS MicroTec/DELTA80 T3/VP SPEC-KU | 1,860円 | 2,660円 | 2,980円 | 3,730円 | 4,260円 | 5,330円 | イロローム |
| | A08 | レジスト塗布装置 | KANAMEX/KRC-150CBU | 950円 | 1,360円 | 1,520円 | 1,900円 | 2,170円 | 2,710円 | イロローム |
| | A09 | スプレーコータ | Ushio/USC-2000ST | 1,210円 | 1,720円 | 1,930円 | 2,410円 | 2,760円 | 3,450円 | イロローム |
| | A10 | レジスト現像装置 | KANAMEX/KD-150CBU | 950円 | 1,360円 | 1,520円 | 1,900円 | 2,170円 | 2,710円 | イロローム |
| | A11 | ウエハスピン洗浄装置 | KANAMEX/KSC-150CBU | 1,770円 | 2,520円 | 2,820円 | 3,530円 | 4,030円 | 5,040円 | イロローム |
| | A12 | ICP質量分析装置 | Agilent Technologies/Agilent7700s | 2,940円 | 4,200円 | 4,710円 | 5,880円 | 6,720円 | 8,410円 | 加工・評価室 |
| | A14 | 有機現像液型レジスト現像装置 | KANAMEX/KD(EB)-150CBU | 1,270円 | 1,810円 | 2,030円 | 2,530円 | 2,900円 | 3,620円 | イロローム |
| | A15 | 大面積超高速電子線描画装置 | ADVANTEST/F7000S-KYT01 | 41,820円 | 59,740円 | 66,910円 | 83,640円 | 95,590円 | 119,480円 | 加工評価室 (クリーンルーム) |
| | A16 | 近接効果補正システム | GenISys/BEAMER Full Package | 1,100円 | 1,570円 | 1,760円 | 2,200円 | 2,510円 | 3,140円 | サテライトオフィス |
| | A17 | 超臨界洗浄・乾燥装置 | Rexam/SCRD401 | 720円 | 1,030円 | 1,160円 | 1,450円 | 1,650円 | 2,070円 | イロローム |
| | A18 | 高圧ジェットリフトオフ装置 | KANAMEX/KLO-2005V1 | 2,400円 | 3,430円 | 3,840円 | 4,800円 | 5,480円 | 6,850円 | イロローム |
| | A19 IB16 | 両面マスク露光&ボンダライメント装置 | SUSS MicroTec/MA/BA8 Gen3 SPEC-KU | 5,420円 | 7,740円 | 8,670円 | 10,840円 | 12,390円 | 15,490円 | イロローム |
| | A20 | 回路&レイアウト設計ツール | Tanner EDA/Tanner Tools Pro | 1,100円 | 1,570円 | 1,760円 | 2,200円 | 2,510円 | 3,140円 | サテライトオフィス |
| | A21 | マスク露光装置 | Heidelberg Instruments/MLA150 | 6,300円 | 9,000円 | 10,080円 | 12,590円 | 14,390円 | 17,990円 | イロローム |
| | A22 | 二光子重畳式3Dプリンター | Heidelberg Instruments/MPO100 | 5,650円 | 8,070円 | 9,040円 | 11,300円 | 12,910円 | 16,140円 | イロローム |
| | A53 | 移動マスク紫外線露光装置 | Japan Science Engineering/MUM-0001 | 5,170円 | 7,390円 | 8,280円 | 10,340円 | 11,820円 | 14,780円 | 桂/クリーンルーム |
| | A54 | 両面マスクライナ露光装置 | Union Optical/PEM-800 | 810円 | 1,160円 | 1,300円 | 1,620円 | 1,850円 | 2,320円 | 桂/クリーンルーム |
| A55 IA05 | 両面マスクライナー | SUSS MicroTec/MA6 B5A SPEC-KU/3 | 3,420円 | 4,880円 | 5,470円 | 6,830円 | 7,810円 | 9,760円 | 桂/クリーンルーム | |
| A56 IA04 | 高速マスク露光装置 | NanoSystem Solutions/DL-1000GS/KCH | 4,890円 | 6,980円 | 7,820円 | 9,780円 | 11,170円 | 13,970円 | イロローム | |
| A57 IA13 | 超微細インクジェット描画装置 | SIJTechnology/ST050 | 1,290円 | 1,840円 | 2,060円 | 2,580円 | 2,950円 | 3,690円 | イロローム | |
| B ナノ材料加工・創製装置 | B01 | 多元スリット装置 (仕様 A) | CANON ANELVA/EB-1100 | 4,840円 | 6,920円 | 7,750円 | 9,690円 | 11,070円 | 13,840円 | 加工・評価室 |
| | B02 | 多元スリット装置 (仕様 B) | CANON ANELVA/EB-1100 | 4,610円 | 6,590円 | 7,380円 | 9,220円 | 10,540円 | 13,170円 | 加工・評価室 |
| | B03 | 電子線蒸着装置 | CANON ANELVA/EB-1200 | 3,800円 | 5,430円 | 6,080円 | 7,600円 | 8,690円 | 10,860円 | クリーンルーム 1 |
| | B05 | プラズマCVD装置 | Sumitomo Precision Products/MPX-CVD | 7,690円 | 10,990円 | 12,310円 | 15,390円 | 17,590円 | 21,980円 | クリーンルーム 1 |
| | B06 | 集束イオンビーム走査電子顕微鏡 | SII NanoTechnology/NVision40PI | 15,520円 | 22,170円 | 24,830円 | 31,030円 | 35,470円 | 44,330円 | 加工・評価室 |
| | B07 | 熱酸化炉 | Koyo Thermo Systems/MT-8X28-A | 1,120円 | 1,600円 | 1,800円 | 2,250円 | 2,570円 | 3,210円 | クリーンルーム 2 |
| | B09 | 磁気中性線放電ドライエッチング装置 | ULVAC/NLD-570 | 6,340円 | 9,050円 | 10,140円 | 12,670円 | 14,480円 | 18,100円 | クリーンルーム 1 |
| | B10 | ドライエッチング装置 | Samco/RIE-10NR-KF | 1,090円 | 1,550円 | 1,740円 | 2,170円 | 2,480円 | 3,100円 | クリーンルーム 2 |
| | B11 | 電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置 | ELIONIX/EIS-1200 | 4,340円 | 6,210円 | 6,950円 | 8,690円 | 9,930円 | 12,410円 | クリーンルーム 2 |
| | B12 | シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム | Sumitomo Precision Products/MLT-SLE-Ox | 5,070円 | 7,250円 | 8,120円 | 10,150円 | 11,600円 | 14,490円 | クリーンルーム 1 |
| | B13 | シリコン犠牲層ドライエッチングシステム | Xactix/Xetch X3B | 2,560円 | 3,650円 | 4,090円 | 5,120円 | 5,850円 | 7,310円 | クリーンルーム 2 |
| | B14 | 赤外フェルト砂レーザ加工装置 | AVESTA PROJECT/CRf-65 | 4,250円 | 6,080円 | 6,810円 | 8,510円 | 9,720円 | 12,160円 | 第2加工・評価室 |
| | B15 | レーザーアニール装置 | AOV/LAEX-1000 | 4,040円 | 5,760円 | 6,460円 | 8,070円 | 9,220円 | 11,530円 | 第2加工・評価室 |
| | B17 | 基板接合装置 | SUSS MicroTec/SB8e SPEC-KU | 4,930円 | 7,040円 | 7,880円 | 9,850円 | 11,260円 | 14,070円 | イロローム |
| | B18 | レーザーダイシング装置 | TOKYO SEIMITSU/Mahoh Dicer ML200 | 8,130円 | 11,610円 | 13,000円 | 16,260円 | 18,580円 | 23,220円 | 加工・評価室 |
| | B19 | ダイシングソー | DISCO/DAD322 | 730円 | 1,050円 | 1,180円 | 1,470円 | 1,680円 | 2,100円 | 加工・評価室 |
| | B20 | 真空マウンター | NEC/VTL-201 | 630円 | 910円 | 1,010円 | 1,270円 | 1,450円 | 1,810円 | 加工・評価室 |
| | B21 | 紫外線照射装置 | Technovision/LED-4082 | 280円 | 400円 | 450円 | 560円 | 640円 | 800円 | 加工・評価室 |
| | B22 | エキスパンド装置 | Technovision/TEX-21BG GR-5 | 150円 | 210円 | 240円 | 300円 | 340円 | 420円 | 加工・評価室 |
| | B23 | ウェッジワイヤボンダ | West Bond/7476D | 320円 | 450円 | 510円 | 630円 | 720円 | 910円 | 第2加工・評価室 |
| | B24 | ボールワイヤボンダ | West Bond/7700D | 320円 | 460円 | 520円 | 650円 | 740円 | 930円 | 第2加工・評価室 |
| | B25 | ダイボンダ | West Bond/7200CR | 290円 | 420円 | 470円 | 590円 | 670円 | 840円 | 第2加工・評価室 |
| | B27 | 赤外透過評価検査/非接触厚み測定機 | MORITEX/Trise-T | 1,220円 | 1,740円 | 1,950円 | 2,430円 | 2,780円 | 3,480円 | イロローム |
| | B29 | 高性能マッフル炉 | AS ONE/HPM-2N | 50円 | 70円 | 80円 | 100円 | 120円 | 150円 | 第2加工・評価室 |
| | B30 | UVオゾンクリーナー・キュア装置 | Samco/UV-300HKU | 670円 | 960円 | 1,070円 | 1,340円 | 1,530円 | 1,910円 | クリーンルーム 2 |
| | B31 | 水蒸気プラズマクリーナー | Samco/AQ-500KU | 1,090円 | 1,550円 | 1,740円 | 2,170円 | 2,480円 | 3,100円 | クリーンルーム 2 |
| | B32 B33 | 真空蒸着装置 | SANVAC/RD-1400 | 750円 | 1,070円 | 1,200円 | 1,490円 | 1,710円 | 2,130円 | 加工・評価室 |
| | B34 | 深堀りドライエッチング装置 | Samco/RIE-800PB-KU | 6,320円 | 9,030円 | 10,110円 | 12,640円 | 14,440円 | 18,050円 | クリーンルーム 1 |
| | B36 | 誘導結合プラズマ反応性イオンエッチング装置 | ULVAC/Gemini-200E | 6,830円 | 9,760円 | 10,930円 | 13,670円 | 15,620円 | 19,530円 | クリーンルーム 1 |
| | B37 | 赤外線ランプ加熱装置 | ADVANCE RIKO/RTP-6 | 410円 | 580円 | 650円 | 820円 | 930円 | 1,170円 | 加工・評価室 |
| | B38 | 原子層堆積装置 | Samco/AD-800LP-KN | 6,500円 | 9,280円 | 10,400円 | 13,000円 | 14,860円 | 18,570円 | クリーンルーム 1 |
| | B39 | UVナノインプリント装置 | EVG/EVG6200TBN | 4,960円 | 7,090円 | 7,940円 | 9,920円 | 11,340円 | 14,170円 | イロローム |
| | B40 | 熱インプリント装置 | EVG/EVG510 | 3,150円 | 4,500円 | 5,040円 | 6,300円 | 7,200円 | 9,000円 | イロローム |
| | B51 | パルン成膜装置 | Specialty Coating Systems/PDS-2010 | 430円 | 610円 | 690円 | 860円 | 980円 | 1,230円 | 桂/クリーンルーム |
| | B52 | ICP-RIE装置 | ULVAC/NE-730 | 600円 | 860円 | 970円 | 1,210円 | 1,380円 | 1,720円 | 桂/クリーンルーム |
| B53 | 簡易RIE装置 | Samco/FA-1 | 390円 | 560円 | 620円 | 780円 | 890円 | 1,110円 | 桂/クリーンルーム | |
| B54 | ウエハ接合装置 | Bondtech/WAP-100 | 5,470円 | 7,810円 | 8,740円 | 10,930円 | 12,490円 | 15,610円 | 桂/クリーンルーム | |
| B55 | ナノインプリント装置 | MARUNI/TP-32937 | 210円 | 300円 | 340円 | 420円 | 480円 | 610円 | 桂/クリーンルーム | |
| B56 | ダイシング装置 | DISCO/DAD322 | 690円 | 980円 | 1,100円 | 1,380円 | 1,570円 | 1,970円 | 桂/化学処理室 | |
| B57 IB26 | ナノインプリントシステム | OBUCAT/Eitre3 | 1,290円 | 1,840円 | 2,060円 | 2,580円 | 2,950円 | 3,690円 | 桂/クリーンルーム | |
| B58 IB28 | 電子線蒸着装置 (2) | Osaka Vacuum/OVE-350 | 490円 | 690円 | 780円 | 970円 | 1,110円 | 1,390円 | 桂/クリーンルーム | |
| B59 IB35 | 深堀りドライエッチング装置 | Samco/RIE-800PB-KU | 6,320円 | 9,030円 | 10,110円 | 12,640円 | 14,440円 | 18,050円 | 桂/クリーンルーム | |

表 1-2. 装置等の利用負担金表

| 装置等 | | | 利用料金(一時間当り) | | | | | | 設置場所 | |
|---------------|--------|---------------------------|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| No. | 機器名 | メーカー名 | タイプA | タイプB | タイプC | タイプD | タイプE | タイプF | | |
| C ナノ材料分析・評価装置 | C01 | 超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡 | Hitachi High-Technologies/SU8000 | 5,780円 | 8,260円 | 9,250円 | 11,570円 | 13,220円 | 16,530円 | 加工・評価室 |
| | C02 | 分析走査電子顕微鏡 | Hitachi High-Technologies/SU6600 | 8,060円 | 11,510円 | 12,890円 | 16,110円 | 18,410円 | 23,020円 | 加工・評価室 |
| | C03 | 高速液中原子間力顕微鏡 | RIBM/NanoLiveVision NLV-KS | 3,080円 | 4,400円 | 4,920円 | 6,150円 | 7,030円 | 8,790円 | 設備サポート拠点 |
| | C04 | 走査型プローブ顕微鏡システム | JKP Instruments/NanoWizard III | 2,800円 | 4,000円 | 4,480円 | 5,600円 | 6,400円 | 8,000円 | 第2加工・評価室 |
| | C05 | 共焦点レーザー走査型顕微鏡 | Olympus/FV1000 | 3,000円 | 4,280円 | 4,790円 | 5,990円 | 6,850円 | 8,560円 | 第2加工・評価室 |
| | C06 | 3D測定レーザー顕微鏡 | Olympus/OLS4000-SAT | 1,200円 | 1,720円 | 1,930円 | 2,410円 | 2,750円 | 3,440円 | 加工・評価室 |
| | C08 | 全反射励起蛍光イメージングシステム | Olympus/ | 2,450円 | 3,500円 | 3,920円 | 4,900円 | 5,600円 | 7,000円 | 設備サポート拠点 |
| | C09 | 長時間撮影蛍光イメージングシステム | Olympus/IX81-ZDC2 | 1,860円 | 2,660円 | 2,980円 | 3,720円 | 4,250円 | 5,320円 | 設備サポート拠点 |
| | C10 | X線回折装置 | Rigaku/SmartLab | 3,260円 | 4,660円 | 5,210円 | 6,520円 | 7,450円 | 9,310円 | 加工・評価室 |
| | C11 | 分光エリソメーター | Otsuka Electronics/FE-5000 | 1,990円 | 2,840円 | 3,180円 | 3,970円 | 4,540円 | 5,670円 | クリーンルーム2 |
| | C12 | 光ピンセットシステム | JKP Instruments/NanoTracker | 2,350円 | 3,360円 | 3,760円 | 4,700円 | 5,370円 | 6,710円 | 設備サポート拠点 |
| | C13 | ゼータ電位・粒径測定システム | Otsuka Electronics/ELS2-2Plus | 1,290円 | 1,840円 | 2,060円 | 2,570円 | 2,940円 | 3,680円 | 第2加工・評価室 |
| | C14 | ダイナミック光散乱光度計 | Otsuka Electronics/DLS-8000DH | 1,710円 | 2,450円 | 2,740円 | 3,420円 | 3,910円 | 4,890円 | 第2加工・評価室 |
| | C16 | マイクロシステムアナライザ | Polytec/MSA-500-TPM2-20-D | 3,390円 | 4,850円 | 5,430円 | 6,790円 | 7,760円 | 9,700円 | 加工・評価室 |
| | C17 | (プローブ) | MICRONICS/Model 708FT | 760円 | 1,080円 | 1,210円 | 1,510円 | 1,730円 | 2,160円 | 加工・評価室 |
| | C18 | (真空プローブ) | Cascade Microtech/PLV50 | 2,960円 | 4,230円 | 4,740円 | 5,920円 | 6,760円 | 8,460円 | 加工・評価室 |
| | C19 | パワーデバイスアナライザ+ (C17プローブ) | Agilent Technologies/B1505A | 960円 | 1,370円 | 1,530円 | 1,910円 | 2,190円 | 2,740円 | 加工・評価室 |
| | C20 | インピーダンスアナライザ+ (C18真空プローブ) | Agilent Technologies/4294A | 400円 | 570円 | 630円 | 790円 | 910円 | 1,130円 | 加工・評価室 |
| | C21 | 光ヘテロダイン微小振動測定装置 | NEOARK/MLD-230D-200K | 1,270円 | 1,810円 | 2,030円 | 2,530円 | 2,900円 | 3,620円 | 第2加工・評価室 |
| | C22 | 超微小材料機械変形評価装置 | ELIONIX/ENT-2100 | 1,270円 | 1,810円 | 2,030円 | 2,530円 | 2,900円 | 3,620円 | 第2加工・評価室 |
| | C24 | セルテストシステム | Solartron Analytical | 1,260円 | 1,800円 | 2,010円 | 2,520円 | 2,870円 | 3,590円 | 第2加工・評価室 |
| | C25 | 卓上顕微鏡(SEM) | Hitachi High-Technologies/TM3000 | 470円 | 670円 | 750円 | 930円 | 1,070円 | 1,340円 | クリーンルーム1 |
| | C26 | 高周波伝送特性測定装置 (C27+C28+C29) | APOLLOWAVE/α150 | 420円 | 600円 | 670円 | 840円 | 960円 | 1,200円 | 加工・評価室 |
| | C27 | (RFプローブキット) | Cascade Microtech/ZPROBE | 170円 | 250円 | 280円 | 340円 | 390円 | 490円 | 加工・評価室 |
| | C28 | (ネットワークアナライザ) | ROHDE&SCHWARZ/ZVB14 | 430円 | 610円 | 680円 | 850円 | 970円 | 1,220円 | 加工・評価室 |
| | C29 | (半導体パラメータアナライザ) | Keithley Instruments/4200-SCS | 420円 | 600円 | 670円 | 840円 | 960円 | 1,200円 | 加工・評価室 |
| | C30 | 強誘電体特性評価システム | TOYO/FCE-3 | 860円 | 1,230円 | 1,380円 | 1,720円 | 1,970円 | 2,460円 | 加工・評価室 |
| | C31 | 接触式シート抵抗測定器 | NAPSON/Cresbox | 370円 | 530円 | 590円 | 740円 | 850円 | 1,060円 | 加工・評価室 |
| | C32 | 触針式段差計 | Veeco Instruments/Dektak150 | 550円 | 790円 | 880円 | 1,100円 | 1,260円 | 1,580円 | クリーンルーム2 |
| | C33 | | | 加工・評価室 | | | | | | |
| | C34 | ウエハプロファイラ | KLA/Zeta-388 | 6,520円 | 9,310円 | 10,430円 | 13,030円 | 14,900円 | 18,620円 | クリーンルーム2 |
| C51 | 光干渉膜厚計 | FILMETRICS/F20 | 290円 | 420円 | 470円 | 590円 | 670円 | 840円 | 桂/化学処理室 | |

備考

1 上記表中の利用料は以下の利用タイプに区分された1時間当たりの機器利用に係る金額(消費税相当額を含む)であり、これに当該機器の利用時間数を乗じた金額が利用料金となります。

- ・タイプA: 学術研究機関の利用、学術研究機関との共同研究による企業のARIM事業(データ提供あり)に基づく利用、中小企業のARIM事業(データ提供あり)に基づく利用(標準利用負担金(タイプF)の額の35%を10円単位で四捨五入した額とする。)
- ・タイプB: 学術研究機関の利用、学術研究機関との共同研究による企業のARIM事業(データ提供なし)に基づく利用、中小企業のARIM事業(データ提供なし)に基づく利用(標準利用負担金(タイプF)の額の50%を10円単位で四捨五入した額とする。)
- ・タイプC: 中小企業を除く企業のARIM事業(データ提供あり)に基づく利用(標準利用負担金(タイプF)の額の56%を10円単位で四捨五入した額とする。)
- ・タイプD: 中小企業を除く企業のARIM事業(データ提供なし)に基づく利用(標準利用負担金(タイプF)の額の70%を10円単位で四捨五入した額とする。)
- ・タイプE: ARIM事業に基づかない学術研究機関との共同研究による企業の利用(標準利用負担金(タイプF)の額の80%を10円単位で四捨五入した額とする。)
- ・タイプF: ARIM事業に基づかない企業の単独利用

注) ARIM事業: 文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ事業」

- 1時間未満の機器利用及び1時間を超える機器利用に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の機器利用として、利用料金を算出するものとします。
- 複数の機器を利用する場合については、各機器の利用料を合算した金額が利用料金となります。
- 上記装置等を利用する場合は、利用負担金のほかに、表4の基本料金を負担いただきます。
- 中小企業とは中小企業基本法第2条における中小企業者の範囲に含まれる者を言います。

| 業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
|--------|---|
| 製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
| 卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
| 小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
| サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |

表 2. 装置等の利用負担金の上限

| 利用者種別 | 利用料（1テーマ当たり） |
|---|--------------|
| 下記のうち、ARIM事業（データ提供あり）に基づく利用者 <ul style="list-style-type: none"> ・ 京都大学の教職員及び学生 ・ 学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者 ・ 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者 | 400万円 |
| 下記のうち、ARIM事業（データ提供なし）に基づく利用者、またはARIM事業に基づかない利用者 <ul style="list-style-type: none"> ・ 京都大学の教職員及び学生 ・ 学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者 ・ 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者 | 600万円 |
| 上記以外の者 | 1,700万円 |

備考

- 1 上記表中の装置利用料は、1テーマ当たりの利用に係る上限額（消費税相当額を含む）です。なお、1テーマの継続期間6ヶ月です。

表 3. 技術代行における技術料

| |
|--------|
| 1時間当たり |
| 8,800円 |

備考

- 1 上記表中の料金は、1時間の技術代行にかかる金額(消費税相当額を含む。)であり、これに利用時間数を乗じた金額を技術料とします。なお、上記の利用時間は、装置時間と事前検討に要する時間等を合計した時間とします。
- 2 1時間未満の技術代行及び1時間を超える技術代行に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の技術代行として、技術料を算出するものとします。
- 3 技術代行においても、上記の装置利用負担金及び表4の基本料金を負担いただきます。

表 4. 基本料金表

| 利用者種別 | 基本料金（1装置・1時間当たり） |
|---|------------------|
| (1) ARIM事業（データ提供あり）を利用する京都大学の教職員及び学生 (2) ARIM事業（データ提供あり）を利用する学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者 (3) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、ARIM事業（データ提供あり）の利用者 (4) ARIM事業（データ提供あり）を利用する中小企業 | 530円 |
| (5) ARIM事業（データ提供なし）を利用する京都大学の教職員及び学生 (6) ARIM事業（データ提供なし）を利用する学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者 (7) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、ARIM事業（データ提供なし）の利用者 (8) ARIM事業（データ提供なし）を利用する中小企業 | 750円 |
| (9) ARIM事業（データ提供あり）を利用する中小企業以外の企業 | 840円 |
| (10) ARIM事業（データ提供なし）を利用する中小企業以外の企業 | 1,050円 |
| (11) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、ARIM事業に基づかない利用者 | 1,200円 |
| (12) 企業等に属しARIM事業に基づかないで利用する者 (13) その他、上記(1)~(12)に該当しない者 | 1,500円 |

備考

- 1 上記表中の基本料金は、1装置・1時間当たりの料金であり、これに各装置の利用時間数を乗じた金額をご負担頂きます。（基本料金は装置維持管理等に係る費用の一部に充当します。）

注) ARIM事業：文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ事業」

表 5. サテライトラボ（専有部分）・セミナー室（実験室等という）の利用料金

| 実験室等 | 利用料 | |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| | 1日当たり・1平方メートル当たり | 1時間当たり・1平方メートル当たり |
| サテライトラボ (専有部分) セミナー室 | 168円 | 21円 |

備考

- 1 上記表中の料金は、実験室等の床面積1平方メートルあたりの1日又は1時間の利用にかかる金額（消費税相当額を含む）であり、これに当該実験室等の床面積及び利用日数又は利用時間数を乗じた金額とします。
- 2 1時間未満の実験室等利用及び1時間を超える実験室等利用に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の実験室等利用と利用料金を算出するものとします。
- 3 複数の実験室等を利用する場合には、各実験室等の利用料を合算した金額を利用料金とします。

表 6. 装置等の利用中止に伴うキャンセル料

| 区 分 | キャンセル料 |
|----------------------|--------------|
| 装置利用日の6営業日前から2営業日前まで | 利用負担金の額の25% |
| 装置利用日の4営業日前から5営業日前まで | 利用負担金の額の50% |
| 装置利用日当日から3営業日前まで | 利用負担金の額の100% |

備考

- 1 キャンセル料に円未満の端数が出た場合は、その端数を切り上げるものとします。

表7. 技術補助における技術料

| |
|--------|
| 1時間当たり |
| 8,800円 |

備考

- 技術補助とは、利用者からの依頼、もしくはナノハブ職員からの提案に基づいて行う下記のような業務です。
 - ナノハブ職員が、利用時に立ち会って適宜行う装置操作等の補助
 - ナノハブ職員との利用開始後の技術相談（なお、利用開始前の技術相談は無料です。）
 - ナノハブ職員が、対象となる利用者のために行う個別対応のプロセス条件最適化検討
 - ナノハブ職員が、対象となる利用者のために行う個別対応のプログラミング
- 上記表中の料金は、1時間の技術補助にかかる金額(消費税相当額を含む。)であり、これに利用時間数を乗じた金額を技術料とします。
 なお、上記の利用時間は、装置時間と事前検討に要する時間等を合計した時間とします。
- 1時間未満の技術補助及び1時間を超える技術補助に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の技術補助として、技術料を算出するものとします。
 但し、短時間で対応可能な場合は除きます。

表8. 事前講習費（オパトレ費）

※技術講習とは、利用者が初めて使用する装置について、事前に操作法などを修得していただく講習です。

| 利用者種別 | 事前講習費（1時間当たり） | |
|---|---------------|-------------------|
| | 標準試料を用いた事前講習 | 標準試料以外の試料を用いた事前講習 |
| (1) ARIM事業（データ提供あり）を利用する京都大学の教職員及び学生 (2) ARIM事業（データ提供あり）を利用する学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者 (3) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、ARIM事業（データ提供あり）の利用者 (4) ARIM事業（データ提供あり）を利用する中小企業 | 1,540円 | 3,080円 |
| (5) ARIM事業（データ提供なし）を利用する京都大学の教職員及び学生 (6) ARIM事業（データ提供なし）を利用する学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者 (7) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、ARIM事業（データ提供なし）の利用者 (8) ARIM事業（データ提供なし）を利用する中小企業 | 2,200円 | 4,400円 |
| (9) ARIM事業（データ提供あり）を利用する中小企業以外の企業 | 2,460円 | 4,930円 |
| (10) ARIM事業（データ提供なし）を利用する中小企業以外の企業 | 3,080円 | 6,160円 |
| (11) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、ARIM事業に基づかない利用者 | 3,520円 | 7,040円 |
| (12) 企業等に属しナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかないで利用する者 (13) その他、上記（1）～（7）に該当しない者 | 4,400円 | 8,800円 |

備考

- 上記表中の料金は、1時間の事前講習にかかる金額(消費税相当額を含む。)であり、これに利用時間数を乗じた金額を事前講習費とします。
- 1時間未満の事前講習及び1時間を超える事前講習に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の事前講習として、算出するものとします。
 但し、短時間で対応可能な場合は除きます。
- なお安全教育（初めてナノハブを利用される方に対して、施設・装置の利用に関する注意をお伝えするもの）については無料です。
- 上記事前講習費に加えて、下記料金を合わせて負担していただきます。
 - 表9に示す事前講習時の装置利用負担金
 - 表4に示した基本料金
 - 事前講習に要する消耗品費

注) ARIM事業：文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ事業」

表9. 事前講習費時の装置負担金

事前講習に用いる試料と利用者種別によって下表のように区分してします。

| 利用者種別 | ナノハブ拠点の準備する標準試料を用いた事前講習時の装置利用負担金 | ナノハブ拠点の準備する標準試料以外の試料を用いた事前講習時の装置利用負担金 |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| (1) ARIM事業（データ提供あり）を利用する京都大学の教職員及び学生 (2) ARIM事業（データ提供あり）を利用する学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者 (3) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、ARIM事業（データ提供あり）の利用者 (4) ARIM事業（データ提供あり）を利用する中小企業 | 表1（タイプA）に示した装置利用負担金の半額 | 表1（タイプA）に示した装置利用負担金 |
| (5) ARIM事業（データ提供なし）を利用する京都大学の教職員及び学生 (6) ARIM事業（データ提供なし）を利用する学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者 (7) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、ARIM事業（データ提供なし）の利用者 (8) ARIM事業（データ提供なし）を利用する中小企業 | 表1（タイプB）に示した装置利用負担金の半額 | 表1（タイプB）に示した装置利用負担金 |
| (9) ARIM事業（データ提供あり）を利用する中小企業以外の企業 | 表1（タイプC）に示した装置利用負担金の半額 | 表1（タイプC）に示した装置利用負担金 |
| (10) ARIM事業（データ提供なし）を利用する中小企業以外の企業 | 表1（タイプD）に示した装置利用負担金の半額 | 表1（タイプD）に示した装置利用負担金 |
| (11) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、ARIM事業に基づかない利用者 | 表1（タイプE）に示した装置利用負担金の半額 | 表1（タイプE）に示した装置利用負担金 |
| (12) 企業等に属しARIM事業に基づかないで利用する者 (13) その他、上記（1）～（12）に該当しない者 | 表1（タイプF）に示した装置利用負担金の半額 | 表1（タイプF）に示した装置利用負担金 |

注) ARIM事業：文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ事業」